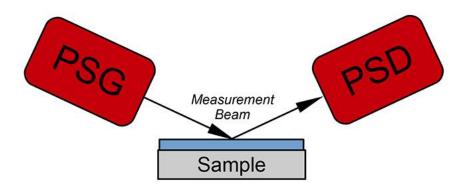


多波长椭偏仪

AUFS-1 椭偏仪是利用椭圆偏振的方法对样品进行光学表征。在该系统中由 偏振态发生器 (PSG) 发射已知偏振态的光斜入射到样品上, 然后偏振态检测器 (PSD) 检测反射光的偏振状态。如下图所示



由样品引起的发射光偏振态的变化可以由P偏振光和S偏振光的反射率的比 值决定。比值为复数,如下图所示: 其中 tan (Ψ) 定义了 P 偏振光和 S 偏振 光反射率比值的大小, △定义了 P 偏振光和 S 偏振光的相位差。

$$\rho = \frac{R_p}{R_s} = \tan(\Psi) \cdot e^{i \cdot \Delta}$$

由于该方法测量的是一个比值,因此对光的强度的变化,以及样品缺陷造成 的散射不敏感, 并且在每个波长测量两个参量可获得两个常量例如: 薄膜厚度和 折射率,此外△对薄膜厚度非常敏感,可以使薄膜厚度测量精度到0埃。

上海昊量光电推出的多波长椭偏仪采用长寿命的 LED 光源,可分别提供

Aunion Tech Co.,Ltd

E-Mail: <u>info@auniontech.com</u>



465nm、525nm、580nm 和 635nm 四种不同波长,并使用无移动部件的椭圆偏振检测器,紧凑的系统提供快速可靠的薄膜测量。



通过 1 秒的测量可以精确的测量 0-1000nm 的大多数透明薄膜的厚度。并可以获得 n 和 k 等光学常量。

| Sample | Parameter | Accuracy | Precision |
|----------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| #1) 2 nm Native Oxide on Si | Thickness | 0.092 nm | 0.00094 nm |
| #2) 50 nm Oxide on Si (NIST SRM) | Thickness | 0.32 nm | 0.007 nm |
| | Index @ 633 nm | 0.014 | 0.00016 |
| #3) 100 nm Oxide on Si | Thickness | 0.18 nm | 0.002 nm |
| | Index @ 633 nm | 0.0004 | 0.00002 |
| #4) 1000 nm Oxide on Si | Thickness | 1.0 nm | 0.0048 nm |
| #5) 100-50-100 nm ONO on Si | Top SiO2 Thickness | 0.54 nm | 0.0049 nm |
| | Si3N4 Thickness | 1.0 nm | 0.0096 nm |
| | Bottom SiO2 Thickness | 1.4 nm | 0.013 nm |
| #6) 6 nm TiO2 on Si | Thickness | 0.066 nm | 0.0014 nm |
| | Index @ 633 nm | 0.051 | 0.0008 |
| #7) 70 nm Al2O3 on Si | Thickness | 0.17 nm | 0.0014 nm |
| | Index @ 633 nm | 0.0007 | 0.000046 |
| #8) 500 nm Si3N4 on Si | Thickness | 2.7 nm | 0.048 nm |
| | Surface Roughness | 0.52 nm | 0.0056 nm |
| | Index @ 633 nm | 0.011 | 0.00017 |
| | k @ 633 nm | 0.0006 | 0.000015 |
| #9) 130 nm SiO on Au | Thickness | 1.8 nm | 0.0039 nm |
| | Index @ 633 nm | 0.0076 | 0.000021 |
| | % Void (substrate) | 1.46% | 0.0023% |

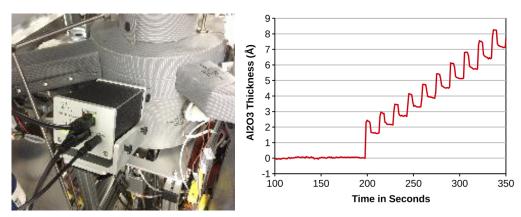
相比于单波长椭偏仪,多波长椭偏仪可测定薄膜厚度,对于透明薄膜测量厚度至少可达 1µm,不存在厚度周期性问题;可确定样品其它其它参数特性例如薄膜粗糙度、多层膜厚度等;对数据分析提供检测依据,一个良好的分析模型应



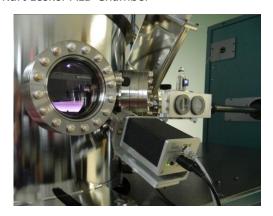
该适用于不同波长的数据;对于非常薄的薄膜(<20nm)多波长椭偏仪提供的数据信息量可以与光谱椭偏仪相媲美。

应用案例:

原位测量:



AUTFS-1 Mounted on Kurt Lesker ALD Chamber



AUTFS-1 Mounted on AJA Sputter Chamber

选配升级:

1、聚焦选项: 将样品上的光束缩小至 0.8 x 1.9 mm 或 0.3 x 0.7 mm





2、聚焦束检验选项



3、自动成像系统



产品特点:

- 多波长
- 椭偏检测器中无移动部件

Aunion Tech Co.,Ltd



- 优异的测量精度 (优于 0.001nm)
- 可原位测量